

**KARTA PRZEDMIOTU**

Kod przedmiotu	studia stacjonarne:	M#2-S1-AiR-705
	studia niestacjonarne:	M#2-N1-AiR-804
Nazwa przedmiotu	Ochrona własności intelektualnej	
Nazwa przedmiotu w języku angielskim	Protection of Intellectual Property	
Obowiązuje od roku akademickiego	2025/2026	

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	Automatyka i Robotyka
Poziom kształcenia	I stopień
Profil studiów	ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	Studia stacjonarne i niestacjonarne
Zakres	Wszystkie
Jednostka prowadząca przedmiot	Katedra Automatyki i Robotyki
Koordynator przedmiotu	dr Magdalena Kotulska-Kmiecik
Zatwierdził	dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów		Przedmiot kształcenia ogólnego
Status przedmiotu		Obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć		Polski
Usytuowanie w planie studiów - semestr	studia stacjonarne	7
	studia niestacjonarne	8
Wymagania wstępne		-
Egzamin (TAK/NIE)		Nie
Liczba punktów ECTS		1

Forma prowadzenia zajęć		wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	inne
Liczba godzin w semestrze	studia stacjonarne:	15				
	studia niestacjonarne:	9				





EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria	Symbol efektu	Efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kierunkowych
Wiedza	W01	Student ma wiedzę nt. źródeł, struktury, funkcji, instytucji prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować oraz dokonać interpretacji norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	AiR1_W15
	W02	Student zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, w tym w szczególności ochrony patentowej. Rozumie znaczenie tej dziedziny prawa dla rozwoju techniki i współczesnej gospodarki.	AiR1_W15
Umiejętności	U01	Student wykazuje umiejętność stosowania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych.	AiR1_U16
	U02	Student potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych. Umie ubiegać się o ochronę dla rozwiązań technicznych tj. wynalazków i wzorów użytkowych.	AiR1_U02
Kompetencje społeczne	K01	Student ma świadomość i zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych.	AiR1_K02
	K02	Student ma świadomość współdziałania i pracowania w grupie oraz postępowania w sposób etyczny w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.	AiR1_K06



**TREŚCI PROGRAMOWE**

Forma zajęć	Treści programowe
wykład	1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: struktura wewnętrzna, źródła prawa własności intelektualnej, modele ochrony, rodzaje dóbr intelektualnych, system gospodarczy a postęp techniczny, funkcje prawa własności intelektualnej. 2. Prawo autorskie: utwór jako przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony, podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe. 3. Ochrona praw autorskich: treść, rodzaje i zakres praw autorskich, dozwolony użytek chronionych utworów, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw autorskich. Ochrona produktów informatycznych i innych rozwiązań wykorzystywanych on-line. Ochrona baz danych. 4. Plagiat inne przejawy nierzetelności naukowej: istota plagiatu, studium przypadków, odpowiedzialność prawna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu. 5. Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym: Urząd Patentowy RP – zadania. 6. Pojęcie wynalazku i wzoru użytkowego, przesłanki zdolności patentowej i ochronnej, procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce. 7. Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych: treść patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy, dozwolony użytek w prawie patentowym, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. Rola rzecznika patentowego w postępowaniach przed UP RP.

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia					
	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Projekt	Sprawozdanie	Inne
W01			X	X		X
W02			X	X		X
U01			X	X		X
U02				X		X
K01						X
K02						X



**FORMA I WARUNKI ZALICZENIA**

Forma zajęć	Forma zaliczenia	Warunki zaliczenia
wykład	zaliczenie z oceną	Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium; przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej; rozwiązanie określonego problemu prawnego (kazuś).

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS													
Lp.	Rodzaj aktywności	Obciążenie studenta										Jednostka	
		studia stacjonarne					studia niestacjonarne						
1.	Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów	W	C	L	P	S	W	C	L	P	S	h	
		15					9						
2.	Inne (konsultacje, egzamin)	2					2					h	
3.	Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	17					11					h	
4.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	0,68					0,44					ECTS	
5.	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	8					14					h	
6.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy	0,32					0,56					ECTS	
7.	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym	0					0					h	
8.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym	0					0					ECTS	
9.	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	25					25					h	
10.	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta</i>	1										ECTS	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



LITERATURA I ŹRÓDŁA PRAWA

1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
3. Ustawa – prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170).
4. Strona internetowa Urzędu Patentowego: <https://uprp.gov.pl/pl>.



Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt „Dostosowanie kształcenia w Politechnice
Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-IP.08-0234/23



Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn